

О заполнении дислокационных уровней в сильных электрических полях

© З.А. Велиев

Нахичеванский государственный университет им. Ю.Г. Мамедалиева Азербайджанской Республики
373630 Нахичевань, Азербайджан

(Получена 18 марта 1997 г. Принята к печати 30 мая 1997 г.)

Посвящена теоретическому исследованию зависимости коэффициента заполнения энергетических уровней краевой дислокации электронами в зависимости от внешнего электрического поля. Получено аналитическое выражение для коэффициента заполнения. Установлено, что с ростом напряженности электрического поля коэффициент заполнения дислокации уменьшается.

1. Одной из причин нелинейности вольт-амперных характеристик полупроводниковых кристаллов с дислокациями является зависимость коэффициента заполнения электронных уровней дислокаций f от внешнего электрического поля. Причиной этой зависимости является то, что при наложении электрического поля сечение захвата электронов σ и коэффициент тепловой ионизации электронов β , захваченных на дислокационный центр, изменяются независимым образом. Вследствие этого коэффициент заполнения f в произвольных электрических полях зависит от напряженности поля \mathcal{E} сложным образом.

Настоящая работа посвящена рассмотрению коэффициента заполнения энергетических уровней дислокации электронами в зависимости от электрического поля.

2. Коэффициент заполнения дислокации в стационарных условиях определяется уравнением

$$\sigma v n(0)(1 - f) = \beta f. \quad (1)$$

Здесь v — средняя скорость электронов, $n(0)$ — концентрация свободных электронов на вершине дислокационного барьера. Таким образом,

$$f = [1 + \beta/\sigma v n(0)]^{-1}, \quad (2)$$

и чтобы определить зависимость f от электрического поля, следует знать зависимости величин σ и β от \mathcal{E} .

Для конкретного расчета этих величин возьмем модель краевой дислокации, предложенную в работе [1], где помимо электростатического поля учитывается еще и потенциальная энергия упругого поля дислокации:

$$U(r, \theta) = U_0 \ln(R/r) - (Wb/r) \cos \theta + l\mathcal{E}r \cos \theta. \quad (3)$$

Здесь $U_0 = 2e^2/\varepsilon a$, ε — диэлектрическая проницаемость полупроводника, a — период решетки вдоль дислокации,

$$W = G(1 - 2\nu)/(1 - \nu),$$

G — константа деформационного потенциала, ν — коэффициент Пуассона, \mathbf{b} — вектор Бюргерса дислокации, R — радиус ридовского цилиндра заряженной дислокации. Выражение (3) записано в цилиндрических координатах r, θ, z . Ось z направлена вдоль оси дислокации, а

вектор напряженности электрического поля параллелен оси x .

Для вычисления сечения захвата σ и коэффициента термической ионизации электронов с дислокационного центра β мы использовали также модель каскадного захвата, развитую в работе [2]. Во внешнем электрическом поле потенциальная яма вблизи дислокации искажается. Дискретным уровням энергии в такой яме соответствуют отрицательные значения полной энергии $|E| \leq \Delta$. Величина Δ определяется из условия $\partial E/\partial r = 0$ при $r = r_s(\mathcal{E})$, где

$$r_s = U_0 [(1 + 4Wbe\mathcal{E}/U_0^2)^{1/2} - 1]/2e\mathcal{E},$$

$$\Delta = -U_0 \ln \left\{ U_0 R [(1 + 4Wbe\mathcal{E}/U_0^2)^{1/2} - 1]/2Wb \right\} + U_0 [1 + (4Wbe\mathcal{E}/U_0^2)^{1/2}]. \quad (5)$$

Окончательные зависимости сечения захвата и коэффициента ионизации от приложенного поля имеют вид

$$\sigma(\xi) = \beta \left(\frac{2\pi\hbar^2}{mkT} \right)^{3/2} \frac{[(\Delta/kT)^2 + \mu]^\mu}{v\mu^{\mu+3/2}\mathcal{U}(3/2, \mu + 5/2, \mu)} \times \exp(E_D/kT), \quad (6)$$

$$\beta = \frac{mU_0^2 Z_{s0}^2}{4l_0\pi\hbar^3} \exp[-(E_D - \Delta)/kT] \ln(Z_s/a). \quad (7)$$

Здесь $\mathcal{U}(x, y, z)$ — гипергеометрическая функция Куммера, $\mu = (\mathcal{E}/\mathcal{E}_0)^2$ — параметр, характеризующий степень разогрева электронов,

$$\mathcal{E}_0 = (6mkT)^{1/2}(mG)^2 kT/\pi e \rho s^2 \hbar^4,$$

m — масса электрона, ρ — плотность кристалла, s — скорость звука в кристалле,

$$r_{s0} = Wb/U_0;$$

E_D — глубина дислокационного уровня; величина l_0 связана с длиной свободного пробега l , обусловленной рассеянием на акустических фононах, соотношением $l_0 = l(kT/2ms^2)$, k — постоянная Больцмана.

Подставляя (6) и (7) в (2), для коэффициента заполнения получим

$$f = 1 + \frac{2}{n_d} \left(\frac{mkT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{\mu^\mu Q\left(\frac{3}{2}, \mu + \frac{5}{2}, \mu\right)}{[(\Delta/kT)^2 + \mu]^\mu} \times \exp\left[-\frac{E_D - e\varphi(0)}{kT}\right], \quad (8)$$

где n_d — концентрация объемных доноров.

В пределе слабого электрического поля, когда $\mu \ll 1$ и $\mu^\mu Q\left(\frac{3}{2}, \mu + \frac{5}{2}, \mu\right) \rightarrow 1$ (см. [3]), формула (8) принимает обычный вид

$$\left[1 + \exp\left(-\frac{E_D - e\varphi(0) + \eta_0}{kT}\right) \right]^{-1}. \quad (9)$$

$\eta_0 = kT \ln(N_c/n_d)$ — невозмущенное значение химического потенциала электронов в кристалле, N_c — эффективная плотность состояний.

В пределе сильного электрического поля $\mu \gg 1$ выражение (8) принимает вид

$$f = \left\{ 1 + \frac{1}{2\pi n_d} \left(\frac{mkT_e}{\hbar^2} \right)^{3/2} \left(\frac{2}{3} \right)^{3/4} \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{\sqrt{2}} \times \exp\left[-\frac{E_D - \Delta}{kT} + \frac{3}{2} \left(\frac{\Delta}{kT_e} \right)^2 + \frac{e\varphi(0)}{kT}\right] \right\}^{-1}. \quad (10)$$

Здесь $kT_e = e\mathcal{E}l\delta^{-1}$ — температура электронной подсистемы в электрическом поле, $\delta = ms^2/kT$ — параметр квазиупругого рассеяния, $\Gamma(x)$ — гамма-функция.

Из (10) видно, что с ростом электрического поля величина f уменьшается. Это связано с тем, что в сильных электрических полях глубина дислокационной ямы уменьшается. Поэтому процесс ионизации доминирует над процессом захвата, что и приводит к уменьшению f .

3. Заметим, что при получении формул для σ и β мы предполагали, что $kT_e \gg \Delta$ и $T_e \gg T$. К этим неравенствам надо еще добавить неравенство $1 < r_s(\mathcal{E})/l \ll \delta^{-1}$, которое соответствует, с одной стороны, применимости модели каскадного захвата, а с другой — зависимости функции распределения связанных на дислокации электронов от их полной энергии.

Теперь оценим область применимости формул (9) и (10) по электрическому полю. Для кристалла Si: $a \simeq 5 \cdot 10^{-10}$ м, $m \simeq 2.4 \cdot 10^{-31}$ кг, $s \simeq 5 \cdot 10^3$ м/с, $\rho \simeq 2.3 \cdot 10^3$ кг/м³, $G \simeq 10^{-18}$ Дж, а $\mathcal{E}_0 \simeq 10^3$ В/м при $T = 300$ К, т.е. формула (9) справедлива, когда $\mathcal{E} \ll 10^3$ В/м, а формула (10) — при $\mathcal{E} > 10^3$ В/м.

Список литературы

- [1] V.B. Shikin, N.I. Shikina. Phys. St. Sol. (a), **108**, 669 (1988).
- [2] В.Н. Абакумов, И.Н. Ясиевич, В.И. Перель. ФТП, **12**, 3 (1978).
- [3] *Справочник по специальным функциям* (М., Наука, 1978) с. 321.

Редактор Т.А. Полянская